This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

平2-122647 四公開特許公報(A)

Solnt. Cl. 3 H 01 L 21/68 證別記号 庁内整理番号 母公開 平成2年(1990)5月10日

7454-5F D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

半導体ウエハ移替装置 49発明の名称

> **2047** 頭 昭63-274422

29出 願 昭63(1988)11月1日

正拳 潼 口 **@**発明者 沖電気工業株式会社 の出 顧 人

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

②代 理 人 外1名 弁理士 清水

1. 発明の名称

半導体ウエハ移替箔置

2. 特許請求の範囲

複数技の半導体のエハを収納した収納のエハキ +リアと、ほ収納ウエハキャリアに対応する空ウ エハキャリアとを共に関ロ側を上向きにして配置 し、旅収納ウエハキャリアの下部より半導体ウエ ハを突き上げる突き上げてームと、は突き上げて ームにより上部に突き上げられたりエハを把持す る把持アームを有し、各々が上下動及び遅縮移動 することによって収納ウエハキャリアより空ウエ ハキャリアに半導体ウエハを移し替える装置であ

半導体ウエハを1枚から5枚まで各々独立して 数置する複数の意思ハンドを配偶し、複数置ハン ドを前記文を上げて一「に対して各々自動的に交 換可能にしたことをむほとする半導体ウェハの移 分装置.

3. 発明の詳細な説明

(遺雲上の利用分野)

本登明は、半導体ウエハ(以下、単にウエハと いう)の移撃装置に係り、特に少枚数のウェハの 移替装置に関するものである。

(は冬の枝姿)

近年、半導体の生産方式が少品種多量生産から 多品種少量生産へと変化しつつあり、半導体製造 工場の生産ラインにおいても、一つのウェハキャ リアの中に同一機能のクエハが入ったものから、 複数機種のウェハが入ったものまで、植々の形態 が存在するようになり、管理も非常に復雑化して きている.

訳えば、ASIC(特定用途向け IC)の生産工程 のように、ウエハキャリア中に収納されたウエハ (量大25枚)は全工程の大半で同一に処理され、 農株工程に近づくと幾つかの枚数に分割され、各 4単独のウェハキャリアに収納される。そして、 最後の工程まで処理される場合や、ある工程で分 割されたウェハがその工程を終了して、声び元の 構成に戻るような場合等は、工程中においてウェ ハの移し替えられる頻度が非 に高くなるので、 ウェハのクリーン度の確保や短時間での移し替え か必要とされる。

このような状況の下で、生産ライン中のウェハの移し替えは人手によりピンセットで1 技ずつ行われたり、自動化した場合でも1 技ずつ取いはウェハキャリアの最大収納収数25 改全部を一度に移し替える方法が一般的であった。

第5関乃至第7団は従来のウェハの移身状態を 示す団である。

到 5 図は人手によりピンセットにてウエハを! 改ずつはし替える方法を説明する図、第 6 図は自動的に 1 枚ずつ移し替える方法を説明する図、第 7 図は25枚を一度に自動的に移し替える方法を設 明する図である。

第5回において、1は複数の半悪体ウェハ4が 収納されたウェハキャリア、2はウェハキャリア 1からピンセット3にて取り出されたウェハ、5 は抄し替えのために準備された空のウェハキャリ

された空のウェハキャリア5の何へ180° 回転し、 それまでとは逆の動作によりウェハキャリア5の 中へウェハ2を収納する。この動作の辿り返しに より、ウェハキャリア1中のウェハイは全部ウェ ハキャリア5の中へ移し替えられる。

 アを示す。

第5回に示す方法では、ウェハキャリア1の中の半導体ウェハ4を、任意の位置から任意の收数だけ人の判断によりピンセット3で1枚ずつ空のキャリア5へ移し替える。

第6回に示す方法では、神経、上下、回転の3 機能を有した潜馬ロボットハンド 6 により、一定 ピッチ (例えば4.76 m/m) ずつ上下動するエレベーション機構(図では苦味) に搭載されたウエハキャリア1中のウエハイをカリン、の中へとしての力とは逆動作となって、空気の中でのは起動にしている。 のいる。 動作の場合を示している。 動作の場合を示している。 動作の場合を示している。 動作の関係によっていまりによっているがウェハを把付し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のによりは、一定なり出し、動作のにより出し、動作のにより出し、動作のによります。

る方法である。この場合、突き上げアーム8.9 はウェハ4を観響し得る構造を育している。

(免明が解決しようとする課題)

しかしながら、以上述べた3種類の方法では、 第5回に示すように、ピンセットによりウエハを 記得するため、ウニハにバターン欠陥となるよう なダメージやパーティクルの発生を与えたり、人 が至近距離にいるための聴族の付着による多智ま り低下を招いたりすることがあった。

また、第6回に示すように、ウエハをし枚ずつ 移観するため、数枚から十数枚の移し替えに時間 がかかったり、第7回に示す方法では、少枚数に 分割して移し替えることが不可能であるという問 歴点があった。

本発明は、以上述べたピンセットによるパーティクルの付着による歩智まり低下や、移し替え時間が長時間必要であったり、少枚数を分割して移し替えられないという問題点を除去するために、 どのような枚数でも自動的に、かつ短時間にウェ ハの移し替えが可能な半導体ウェハ移替装置を提

供することを目的とする。

(規則を解決するための手段)

(作用)

本発明によれば、半導体ウエハ移撃装置において、ウエハキ+リアの上部には最大ウエハ5枚を 肥持できる関防機構を持った肥持アームを絞け、

及び上下、検渉動機構を有した肥持アーム、21万 至25は突き上げアーム16に着脱可能で、各々3枚。 1枚、2枚、4枚、5枚のウェハを観電できる観 電部材、17は突き上げアーム16が機構部15を介し て検渉動する機方向スライド機構部である。

移し替えの例として、例えば、8枚の移し替え を行う場合について評価に設明する。

第2図に示すように、固定部10に固定され、かつ変面が関ロし、しかもウェハ12が収納されたウェハキャリア11をセットし、上端部にウェハ3枚を設置可能な超型部材21を取り付けた突き上げアーム16をこの下方から上昇させ、点線で示すように、ウェハキャリア11を質適して指示された位置のウェハ3枚を知い上げ、把持アーム14の配件部分直下まで上昇させる。この時、把持アーム14は間の状態となっている。

突き上げアーム16の上昇が終了すると、把持アーム14は、数置部材21上のウェハ12の数置高さまで下挿し、そのアール14を閉じてウェハ12を把持した後上型し、突き上げアーム15が下陣を終了す

一方、ウェハキャリアの下部にはウエハを観賞可能な観測ハンドを着訳可能にした突き上げアームを設ける。そして、前紀観測ハンドとして 5 種類を設置し、旗戦調ハンドを突き上げアームに対して自動的に取り変えることにより、は、し、えるウェハの状数に見合ったパンドを選択することができる。

従って、ウェハの枚数に応じた移載を行うこと ができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照しながら詳細に説明する。

第1回は本発明の実施例を示す半部体ウェハ移 替装度の概略構成図、第2回はその半部体ウェハ 移替装置の動作を説明する斜視図、第3回はその 半部体ウェハ移替装置の動作説明図、第4回はそ の半部体ウェハ移替装置の観響部材の専設状態を 示す図である。

これらの図において、11はウエハ12の人ったり エハキャリア、13は空ウエハキャリア、14は原閉

ると、肥持アーム14は彼移動し、空ウェハキャリ ア13の上部の指示された位置まで移動する。この 後、数置部材21を有する突き上げアーム16は、機 機部15を介して機方向スライド機構部17により、 前記把持アーム14に把持されたウェハ12と同位置 まで機移動する。彼移動が完了後、数置部材21を 有する突き上げアーム16は、底面が関ロしている 空ウェハキャリア13を質温して、肥持アーム14の 直下まで上昇し、ウェハ12の受取準備が完了する。

次に、肥粋アーム14が下降し、関動作により観 置都材21上にウエハを移した後上昇する。ウエハ を観置した観覚部材21は、突き上げアーム16の下 舞動作により空ウエハキャリア13を貫通して、そ のキャリア13の下部まで下降する。その下延動作 の途中で、空ウエハキャリア13の中に3枚のウエ ハを置いてくることにより、ウエハ12を移戦する。 このようにして、3枚のウエハの移し替えを完了

その後、突き上げアーム16は根移動し、各種の 数質部材22万至25が配備されている数置部材セッ ト部30の概要部材の設置箇所に到着すると、概定 部材21を5枚のウェハの観電部材25に自動的に変 更し、次の5枚の移し え動作が開始される。

₹.

この報道部材の取替動作を第3.因及び第4図を 用いて説明する。

様に行われ、5枚のウェハの移し替えが完了すると、空ウェハキャリア13の中には合計 8 枚が移し 替えられたことになる。

以上のように構成されるので、1枚から5枚までのウェハ戦運節材21万至25を過宜選択することにより、10枚までは2回、15枚までは3回、20枚までは4回、25枚までは5回の動作にでウェハの移し替えを行うことができる。

なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の理管に基づいて潜々の要影が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

(発明の効果)

以上、詳細に設明したように、本発明によれば、 複数の裁量部材を設置し、その自動交換により移 し替え枚数を通宜選択し、本目の細かいりエハの 移し えを可能としたことにより、少枚数のウエ ハの移し替えから、全収数のウエハの移し替えを 自動的に、しかも独等間に行うことができるため、 半導体ご 造工程での歩智まり向上及び短時間移職 げアーム16をて始方向に移動させ(工程の)、見 に、一X触方向に移動させる(工費Φ)。次に、 突き上げアーム16をY輪方向に移動させ(工程 ⑤)、更に、一名軸方向に移動させる(工程⑥)。 その状態で突き上げアーム15をX輪方向に移動さ せ、次に装着すべきウエハ5枚を敬賀可能な敬置 部材25の設置循所31の下方に位置決めする(工程 ⑦)。即ち、第4図(c) に示すように、厳霊部材 25の係合湖25mに対応する位置に、突き上げアー ム16の先端部16mを位置決めする。次に、突き上 げアーム16を2輪方向に移動させ(工程®)、第 4 図(d) に示すように、突き上げアーム16の先権 郎16 a を観覚部材25の係合演25 a に係合させる。 次に、突き上げアーム16を一X軸方向に移動させ (工程®)、更に、-Y軸方向に移動させ(工程 ②)、引き被告-X輪方向に移動させ、ウエハ5 枚の移し替え工程へ移行する。即ち、次の5枚の ウェハの移し替えは韓国部は25が装着された突き 上げアーム16がウェハキャリア12の指示された位 置へ移動後、前記3枚クエハの移し替え工程と月

による生産強率の角上を図ることができる。

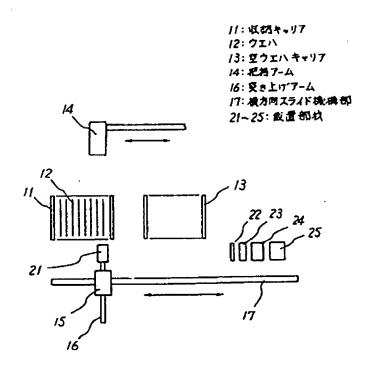
4. 図画の簡単な説明

第1個は本発明の実施例を示す半導体ウェハ移 替装置の戦略構成図、第2個は用半導体ウェハ移 替装置の動作を説明する斜視図、第3回はに用半導体ウェハ移替装置の動作説明図、第4回は用半導体ウェハ移替装置の整置部材の要談状態を示す図、第5回は従来の人手によりピンセットにでウェハを1枚ずつ移し替える方法を説明する図、第7回は従来の25枚を一度に自動的に移し替える方法を説明する図である。

10…固定部、11…ウエハキャリア、12…ウエハ、13…空ウエハキャリア、14…把持アーム、15…機 横部、16…突き上げアーム、16 a …先端部、17… 横方向スライド機構部、21~25…観置部材、21 a …係合演、30…数置部材セット部、31…投置箇所。

許出關人 冲電気工業株式会社 代理人 弁理士 清 水 守(外1名)

特爾平2-122647(5)

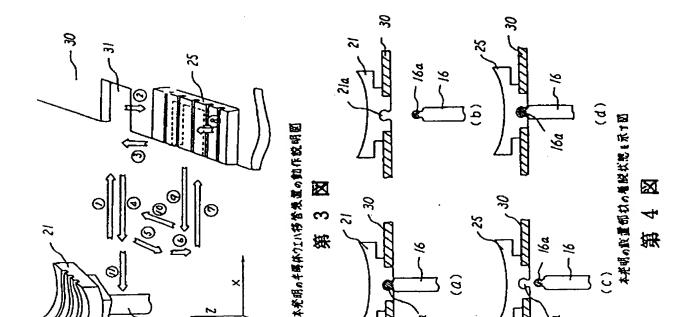


本老明の半等体ウェハ移営設置の概路構成図

第 1 図

12 12 12 13 10 16

本元明。11号件)IV号音集星。125万民号针视图 第 2 図



AE 2

